

● 화학물질안전원고시 제2024-40호

「화학물질관리법」 제24조, 같은 법 시행규칙 제21조에 따른 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」를 다음과 같이 일부개정·고시합니다.

2024년 09월 30일

화학물질안전원장

「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 일부개정

1. 개정이유

획일적으로 적용된 시설기준에 대해서 현장 여건을 반영하여 기준을 개선하고 재정비하고자 함

2. 주요내용

가. 반도체·디스플레이 가스공급설비의 상시 처리기준 합리화

- 상시 누출이 발생하지 않는 가스공급설비에 대해서는 유·누출 발생 시 배출설비가 처리설비로 자동 연결되어 정상 가동되며, 정상 작동에 대한 주기적인 관리기준을 준수하는 경우 상시 처리로 인정

3. 개정 고시 전문은 국가법령정보센터(law.go.kr) 또는 화학물질안전원 누리집(nics.me.go.kr)의 자료실-법령정보 확인